## (19)**日本国特許庁(JP)**

# (12)特許公報(B2)

(11)特許番号 特許第7029643号 (P7029643)

最終頁に続く

(45)発行日 令和4年3月4日(2022.3.4)

(24)登録日 令和4年2月24日(2022.2.24)

友雷装株式会社内

井上 信

(51)国際特許分	· <b>*</b> 指	FI		
H 0 1 R	12/57 (2011.01)	H 0 1 R	12/57	
H 0 1 R	12/71 (2011.01)	H 0 1 R	12/71	
H 0 1 R	13/03 (2006.01)	H 0 1 R	13/03	D
H 0 1 R	13/04 (2006.01)	H 0 1 R	13/04	Е
				請求項の数 7 (全17頁)
(21)出願番号	特願2018-164559(P2018-164559)		(73)特許権者	000183406
(22)出願日	平成30年9月3日(2018.9.3)			住友電装株式会社
(65)公開番号	特開2020-38767(P2020-38767A)			三重県四日市市西末広町1番14号
(43)公開日	令和2年3月12日(2020.3.12)		(74)代理人	110001036
審査請求日	令和2年12月24日(2020.12.24)			特許業務法人暁合同特許事務所
			(72)発明者	中西 雄一
				三重県四日市市西末広町1番14号 住
				友電装株式会社内
			(72)発明者	松田 英一
				三重県四日市市西末広町1番14号 住
				友電装株式会社内
			(72)発明者	坂井 啓人
				三重県四日市市西末広町1番14号 住

審査官

(54)【発明の名称】 端子、基板用コネクタ、およびコネクタ付き基板

## (57)【特許請求の範囲】

## 【請求項1】

回路基板に接続される基板接続部を備える端子であって、

基材と、メッキ層とを備え、

前記基材は、前記メッキ層に覆われる被メッキ面と、露出する露出面とを備え、

前記基板接続部において、前記メッキ層は、前記被メッキ面及び前記露出面を接続する斜面を覆う第1傾斜面を備え<u></u>

前記基板接続部は、前記露出面から角度をなして立ち上がる起立面を備え、

前記起立面は前記基材を露出してなり、

前記メッキ層は、前記被メッキ面及び前記起立面を接続する斜面を覆う第2傾斜面を備える、端子。

## 【請求項2】

請求項1に記載の端子であって、

前記メッキ層は、Snを含む、端子。

## 【請求項3】

請求項1または2に記載の端子であって、

曲げ部分を備える、端子。

## 【請求項4】

請求項1から3のいずれか1項に記載の端子であって、

前記基材の厚みは0.05mm以上0.80mm以下である、端子。

#### 【請求項5】

請求項1から4のいずれか1項に記載の端子と、

前記端子を保持するコネクタハウジングと、を備える基板用コネクタ。

#### 【請求項6】

請求項5に記載の基板用コネクタと、

前記基板用コネクタが実装される回路基板と、

前記回路基板と前記基板接続部とを接続する半田と、を備え、

前記露出面は、前記回路基板に対向して配置される、コネクタ付き基板。

#### 【請求項7】

請求項6に記載のコネクタ付き基板であって、

前記露出面は、前記半田に埋設されてなる、コネクタ付き基板。

【発明の詳細な説明】

## 【技術分野】

### [0001]

本明細書に開示された技術は、端子、基板用コネクタ、コネクタ付き基板、および、端子の製造方法に関する。

#### 【背景技術】

## [0002]

回路基板上に半田付けによって実装される基板用コネクタは、コネクタハウジングと、このコネクタハウジングに保持される端子とを備えており、端子の先端部が半田によって回路基板に固定されている。

#### [0003]

基板用コネクタに備えられる端子の製造方法として、板材を端子の形状に打ち抜いた後に メッキを施す方法(以下、「後メッキ法」という)が知られている。後メッキ法により製 造される端子は、表面全体にメッキ層を有しているので、半田の濡れ上がり性を確保でき る。しかしながら、板材から打ち抜いた端子1つ1つにメッキを施す後メッキ法は、板材 に対してメッキを施した後端子を打ち抜く先メッキ法と比べて、製造コストが高くなる。

### [0004]

この問題を解決するため、打ち抜き前の板材の板面に予めメッキを施しておき、メッキ処理後の板材を打ち抜く際に、メッキ層の一部を、打ち抜き方向へ引きずり打ち抜き切断側面部分へ強制的に押し広げ、当該打ち抜き切断側面部分にもメッキを施す端子の製造方法が提案されている(下記特許文献 1 参照)。

【先行技術文献】

## 【特許文献】

## [0005]

【文献】特開2006-140042号公報

## 【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

#### [0006]

先メッキ法を採用した従来の端子の製造方法では、先メッキ法によってメッキを施したワークに対して、さらに曲げ加工し、基板と接続する部分を備える端子を得ていた。しかしながら、該曲げ加工をする場合、該曲げ加工をしない場合と比べて、端子の製造コストが高くなるという不都合があった。

そこで、本発明は、半田の濡れ上がり性を維持しつつ、端子の製造コストを低減できる端子、基板用コネクタ、コネクタ付き基板、及び、端子の製造方法を提供することを課題とする。

## 【課題を解決するための手段】

## [0007]

本発明によれば、回路基板に接続される基板接続部を備える端子であって、基材と、メッキ層とを備え、前記基材は、前記メッキ層に覆われる被メッキ面と、露出する露出面とを

10

20

30

30

40

備え、前記基板接続部において、前記メッキ層は、前記被メッキ面及び前記露出面を接続 する斜面を覆う第1傾斜面を備える端子が提供される。

#### [00008]

また、本発明によれば、上記の構成を備える端子と、前記端子を保持するコネクタハウジングと、を備える基板用コネクタが提供される。

## [0009]

また、本発明によれば、上記の構成を備える基板用コネクタと、前記基板用コネクタが実 装される回路基板と、前記回路基板と前記基板接続部とを接続する半田と、を備え、前記 露出面は、前記回路基板に対向して配置されるコネクタ付き基板が提供される。

#### [0010]

さらに、本発明によれば、上記の構成を備える端子の製造方法であって、メッキ処理を施して、前記基材から構成される板材の両面にメッキ層を形成し、メッキ板を得るメッキ工程と、前記メッキ板に打ち抜き加工を施して、前記被メッキ面及び露出面を備える端子素片を得る打ち抜き工程と、前記端子素片に圧延加工を施して、前記メッキ層を圧延し、前記第一傾斜面を形成する圧延工程と、を含む端子の製造方法が提供される。

#### [0011]

本発明の端子は、以下の構成をさらに備えていても構わない。

- (1)前記基板接続部は、前記露出面から角度をなして立ち上がる起立面を備え、前記起立面は前記基材を露出してなり、前記メッキ層は、前記被メッキ面及び前記起立面を接続する斜面を覆う第2傾斜面を備えていても構わない。
- (2)前記メッキ層は、Snを含んでいても構わない。
- (3)端子は、曲げ部分を備えていても構わない。
- (4)基材の厚みは0.05mm以上0.80mm以下であっても構わない。

## [0012]

また、上記コネクタ付き基板において、前記露出面は、前記半田に埋設されていても構わない。

## [0013]

また、上記端子の製造方法において、前記メッキ処理は、電解メッキであっても構わない。 【発明の効果】

## [0014]

本発明によれば、半田の濡れ上がり性を維持しつつ、コストダウンを実現できる端子、基板用コネクタ、コネクタ付き基板、及び、端子の製造方法が提供される。

## 【図面の簡単な説明】

- [0015]
- 【図1】本実施形態に係るコネクタ付き基板の斜視図
- 【図2】本実施形態に係る基板用コネクタの背面図
- 【図3】本実施形態に係る基板用コネクタの底面図
- 【図4】本実施形態に係る端子の側面図
- 【図5】本実施形態に係る端子の平面図
- 【図6】本実施形態に係る端子における基板接続部を示す部分拡大側面図
- 【図7】図2の円R1内の拡大図
- 【図8】図3の円R2内の拡大図
- 【図9】本実施形態に係る端子における基板接続部が回路基板に半田付けされた様子を、
- 図6のA-A線で示す位置で切断して示す断面図
- 【図10】本実施形態に係る端子について、図6をB-B線で示す位置で切断して示す断 面図
- 【図11】本実施形態に係る端子について、図6をC-C線で示す位置で切断して示す断 面図
- 【図12】本実施形態に係る端子における基板接続部が回路基板に半田付けされた様子を、図7のD-D線で示す位置で切断して示す断面図

10

20

30

40

【図13】本実施形態に係る金属板材の斜視図

【図14】本実施形態に係るメッキ板の斜視図

【図15】本実施形態に係る端子の製造方法において、打ち抜き工程によって端子素片を得る様子を概略的に示す平面図

【図16】図15のE-E線で示す位置で切断して示す基板接続素片部の断面図

【発明を実施するための形態】

[0016]

< 実施形態 >

以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて説明する。尚、すべての図面において 、同様な構成要素には同様の符号を付し、適宜説明を省略する。

[0017]

本実施形態の端子は、回路基板に接続される基板接続部を備える端子であって、基材と、 メッキ層とを備え、前記基材は、前記メッキ層に覆われる被メッキ面と、露出する露出面 とを備え、前記基板接続部において、前記メッキ層は、前記被メッキ面及び前記露出面を 接続する斜面を覆う第1傾斜面を備える。

[0018]

本発明者らは、十分な半田濡れ性の発現、及び、端子の製造コスト低減を実現するため、 先メッキ法を採用した端子の製造方法について検討した。その結果、打ち抜き工程の方向 を工夫し、さらに、圧延工程で基材の斜面を形成し、該斜面で露出面を挟むことで端子を 製造する場合、先メッキ法を採用した場合でも、十分な半田濡れ性を発現できることを知 見した。

本発明者らは、当該端子の製造方法によって実現する端子の特徴点について、従来公知の端子との差異を検討した。その結果、本発明者は、本実施形態に係る端子は、被メッキ面及び露出面の形状を従来の端子とは異なる形状に制御することにより、半田の濡れ上がり性を維持しつつ、コストダウンを実現できることを知見したものである。

[0019]

(コネクタ付き基板1)

本実施形態に係るコネクタ付き基板1は、図1に示すように、例えば、基板用コネクタ20と、基板用コネクタ20が実装される回路基板10と、回路基板及び基板接続部を接続する半田とを備える。

[0020]

本実施形態に係るコネクタ付き基板1は、例えば、自動車に用いることができる。本実施 形態に係る端子は、例えば、端子30の基板接続部31を形成する曲げ工程を含まない方 法で製造される。これにより、寸法精度を向上できる。したがって、本実施形態に係る端 子30は、例えば、従来の自動車用途の端子と比べて、基材の厚みの小さい小型端子とし た場合でも、好適な寸法精度を発現できるものである。

[0021]

(回路基板10)

回路基板10としては、限定されず、コネクタ付き基板の用途に応じて、公知の回路基板を選択することができる。回路基板10としては、具体的には、プリント配線基板などが挙げられる。

プリント配線基板としては、例えば、絶縁材料により構成される絶縁板の一面または両面に、導電路が形成されるとともに、電子部品が実装されたものを用いることができる。

[0022]

(基板用コネクタ20)

基板用コネクタ20は、図1に示すように、例えば、端子30と、端子30を保持するコネクタハウジング21とを備える。基板用コネクタ20において、端子30は、例えば、回路基板10上の導電路と接続される。

[0023]

コネクタハウジング21とは、例えば、嵌合相手のコネクタハウジング、端子30、回路

10

20

30

40

基板10などのコネクタ部材が接続される接続部材である。

コネクタハウジング21の材料は、例えば、樹脂によって構成される。

図 1 に示すように、コネクタハウジング 2 1 は、例えば、ハウジング本体 2 2 と、このハウジング本体 2 2 を挟んで配置される固定壁部 2 5 とを備えている。

## [0024]

ハウジング本体22は、例えば、端子30を保持する端子保持壁23と、相手コネクタを内部に受け入れ可能な収容部とを備える。端子保持壁23は、例えば、図2に示すように、端子30が圧入される複数の端子圧入孔24を有している。

#### [0025]

固定壁部 2 5 は、例えば、コネクタハウジングを回路基板 1 0 に固定するための部位である。

固定壁部 2 5 は、例えば、図 3 に示すように、それぞれ、固定金具圧入孔 2 6 を有し、内部に、コネクタハウジング 2 1 を回路基板 1 0 に固定するための固定金具 2 7 が圧入される。

#### [0026]

## (端子30)

本実施形態に係る端子は、例えば、相手方部品と電気的に接続される。

本実施形態に係る端子30は、回路基板10が相手方部品と電気的に接続す<u>る金</u>具である。本実施形態に係る端子30は、例えば、図4に示すように、回路基板10に接続される基板接続部31と、相手方部品の端子に接続される端子接続部33と、基板接続部31及び端子接続部33を接続する中間部32とを備える。

基板接続部31と、回路基板10との接続方法としては、具体的には、半田付けなどが挙げられる。

端子接続部33は、例えば、オス端子でもよく、メス端子でも良い。なお、本実施形態に係る端子30は、端子接続部33を形成するために、例えば、曲げ加工をしてもよい。

## [0027]

本実施形態に係る端子は、例えば、1つ以上の曲げ部分を備えることが好ましく、2つ以上の曲げ部分を備えることが好ましい。このような曲げ部分を備える場合でも、本実施形態に係る端子30は好適な寸法精度を実現できる観点で好ましい。

端子30において、曲げ部分は、例えば、中間部32に配置されることが好ましい。これにより、基板用コネクタ20に係る部品の設計の自由度を向上できる観点で好ましい。一例として、2つの曲げ部分(第1曲がり部34、第2曲がり部35)が中間部に配置された端子30を図4に示す。

## [0028]

端子30は、例えば、基材41と、メッキ層44A、44Bとを備える。

基材 4 1 の表面は、例えば、メッキ層によって覆われる被メッキ面と、露出する露出面と を備える。

端子30及び回路基板10が接続される基板接続部31において、基材41は、例えば、被メッキ面及び露出面を接続する斜面を備える。メッキ層は、例えば、基材41の斜面を覆う第1傾斜面を備える。斜面及び第1傾斜面は、本実施形態に係る端子30の製造方法によって形成される特有の形状である。この特有の形状を備えることで、本実施形態に係る端子30は、好適なメッキ濡れ性を発現できる。したがって、回路基板10と、端子30とを強力に固定できる観点で好ましい。

#### [0029]

基材 4 1 としては限定されず、例えば、銅(Cu)を含む金属を用いることができる。また、メッキ層 4 4 A 、 4 4 B としては限定されず、具体的には、スズ(Sn)、ニッケル(Ni)、亜鉛(Zn)、クロム(Cr)などの金属を用いることができる。

詳細なメカニズムは不明であるが、後述する後メッキ法を採用して端子30を製造する場合、圧延工程において、基材41及びメッキ層44A、44Bが追従することが肝要であると推測される。追従の観点から、メッキ層44A、44Bとしては、例えば、スズ(Sn

10

20

30

)を含むものを用いることが好ましい。また、追従性の観点から、スズ (Sn)を含むメッキ層 4 4 A 、 4 4 B と、銅 (Cu)を含む基材 4 1 とを組み合わせて用いることがより好ましい。

#### [0030]

基材 4 1 の厚みは、例えば、0 . 0 5 mm以上であることが好ましく、0 . 0 7 mm以上であることがより好ましく、0 . 0 8 mm以上であることが更に好ましい。これにより、メッキ層 5 2 を圧延するときに基材 4 1 の変形を抑制し、端子 3 0 の寸法精度を向上できる。また、基材 4 1 の厚みは、例えば、0 . 8 0 mm以下であることが好ましく、0 . 7 0 mm以下であることがより好ましく、0 . 6 4 mm以下であることが更に好ましい。これにより、メッキ層 5 2 を圧延するときにメッキを少ない圧力で容易に圧延し、端子 3 0 をより好適にメッキ層 4 4 A 、4 4 B で被覆できる。したがって、十分なメッキ濡れ性を確保できる観点で好ましい。

#### [0031]

本実施形態に係るコネクタ付き基板1における端子30の配置としては限定されない。端子30の配置は、例えば露出面が、回路基板10と対向するように配置されることが好ましい。これにより、十分にメッキ濡れ性を向上することで、端子30と、回路基板10とを強固に接続しつつ、端子30の製造コストの低減を実現することができる。

#### [0032]

また、本実施形態に係るコネクタ付き基板1において、露出面は、例えば、半田に埋設されてなることが好ましい。これにより、十分にメッキ濡れ性を向上することで、端子30 と、回路基板10とを強固に接続しつつ、端子30の製造コストの低減を実現することができる。

## [0033]

以下に図を用いて、より詳細に本実施形態に係る端子の一態様を説明する。この端子30は、図13、図14および図15に示すように、金属板材51の両面にメッキが施されたメッキ板53を打ち抜いて製造されたものであって、図9に示すように、板状の基材41と、メッキ層44A、44Bとを備えている。基材41は、図6、図9、図10、図11に示すように、一対の板面42A、42Bと、両板面42A、42B間を繋

#### [0034]

ぐ端面43とを有している。

図6に示すように、基板接続部31において、端面43のうち基板用コネクタ20が回路基板10に実装される際に回路基板10と対向する面(図6の下面)は、基板対向端面43Aであり、この基板対向端面43Aの一端から角度をなして立ち上がる面(図6の左面)は、第1起立端面43Bであり、基板対向端面43Aの他端から角度をなしてから立ち上がる面(図6の右面)は、第2起立端面43Cである。

## [0035]

一対の板面 4 2 A 、 4 2 B のそれぞれは、全面にわたってメッキ層 4 4 A 、 4 4 B で覆われている。端面 4 3 は、打ち抜きによって形成された面であり、基材 4 1 がメッキ層 4 4 A 、 4 4 B から露出した露出面となっている。

## [0036]

一方の板面42Aのうち、基板対向端面43Aに隣接した領域は、図9に示すように、対向斜面42A1となっており、第1起立端面43Bに隣接した領域は、図10に示すように、第1起立斜面42A2となっており、第2起立端面43Cに隣接した領域は、図11に示すように、第2起立斜面42A3となっている。板面42Aのうち、対向斜面42A1、第1起立斜面42A3を除く残りの領域は、図9、図10、図11に示すように、非傾斜面42A4となっている。対向斜面42A1、第1起立斜面42A2、第2起立斜面42A3は、それぞれ、基板対向端面43A、第1起立端面43B、第2起立端面43Cと非傾斜面42A4とを繋ぐ面である。

### [0037]

他方の板面42Bも同様に、対向斜面42B1、第1起立斜面42B2、第2起立斜面4

10

20

30

40

2 B 3 、および非傾斜面 4 2 B 4 を有している。

#### [0038]

図 9 、図 1 0 、図 1 1 に示すように、 2 つの非傾斜面 4 2 A 4 、 4 2 B 4 は互いに平行であり、対向斜面 4 2 A 1 、 4 2 B 1 、第 1 起立斜面 4 2 A 2 、 4 2 B 2 、第 2 起立斜面 4 2 A 3 、 4 2 B 3 は、非傾斜面 4 2 A 4 、 4 2 B 4 に対して斜めに傾いている。

#### [0039]

より具体的には、2つの対向斜面42A1、42B1は、図9に示すように、基板対向端面43Aに近づくほど互いに近づくように傾斜しており、基材41において基板対向端面43Aに隣接する部分(2つの対向斜面42A1、42B1に挟まれた部分)は、基板対向端面43Aに近づくにつれて先細りとなっている。同様に、2つの第1起立斜面42A2、42B2は、図10に示すように、第1起立端面43Bに近づくほど互いに近づくように傾斜しており、基材41において第1起立端面43Bに隣接する部分(2つの第1起立斜面42A2、42B2に挟まれた部分)は、第1起立端面43Bに近づくにつれて先細りとなっている。さらに同様に、2つの第2起立斜面42A3、42B3は、図11において第2起立端面43Cに近づくほど互いに近づくように傾斜しており、基材41において第2起立端面43Cに隣接する部分(2つの第2起立斜面42A3、42B3に挟まれた部分)は、第2起立端面43Cに

#### [0040]

図9に示すように、一方のメッキ層44Aのうち、対向斜面42A1を覆う部分は、対向傾斜部44A1であり、対向傾斜部44A1の表面は対向傾斜面45A1である。また、図10に示すように、第1起立斜面42A2を覆う部分は、第1起立傾斜部44A2であり、第1起立傾斜部44A2の表面は、第1起立傾斜面45A2である。さらに、図11に示すように、第2起立斜面42A3を覆う部分は、第2起立傾斜部44A3であり、第2起立傾斜部44A3の表面は、第2起立傾斜面45A3である。対向傾斜面45A1、第1起立傾斜面45A2、および第2起立傾斜面45A3は、それぞれ、対向斜面42A1、第1起立斜面42A2および第2起立斜面42A3に沿って傾斜している。

## [0041]

他方のメッキ層44Bも、同様の構成の対向傾斜部44B1、第1起立傾斜部44B2、第2起立傾斜部44B3、および、対向傾斜面45B1、第1起立傾斜面45B2、第2起立傾斜面45B3を有している。

## [0042]

(端子30の製造方法)

本実施形態にかかる端子30の製造方法を以下に説明する。

## [0043]

本実施形態に係る端子の製造方法は、メッキ処理を施して、基材から構成される板材の両面にメッキ層を形成し、メッキ板を得るメッキ工程と、メッキ板に打ち抜き加工を施して、被メッキ面及び露出面を備える端子素片を得る打ち抜き工程と、端子素片に圧延加工を施して、メッキ層を圧延し、第一傾斜面を形成する圧延工程と、を含む。

以下、図13~15を参考として、各工程の詳細を説明する。

## [0044]

<メッキ工程>

メッキ工程は、メッキ処理を施して、基材から構成される板材 5 1 の両面にメッキ層 5 2 を形成し、メッキ板 5 3 を得る工程である(図 1 3 ~ 1 4)。

#### [0045]

メッキ処理としては、具体的には、電解メッキ、無電解メッキなどの処理方法を採用できる。メッキ処理としては、上記具体例のうち、1種または2種以上を組み合わせて用いることができる。メッキ処理としては、電解メッキを採用することが好ましい。従来の端子の製造方法では、例えば、打ち抜き工程をした後、メッキ工程をする場合、打ち抜いた端子を電解液に吊るしてメッキをする。この場合、重力方向にメッキが厚くなる。本実施形態に係る端子の製造方法では、事前にメッキを施した板材を打ち抜く。したがって、これ

10

20

30

により、安価で、量産に向く電解メッキを採用しても、端子のメッキ厚を均一に制御できる観点で都合が良い。

## [0046]

メッキ処理によって形成されるメッキ層 52 の厚さとしては、例えば、0.5  $\mu$  m以上であることが好ましく、0.9  $\mu$  m以上であることが好ましく、0.9  $\mu$  m以上であることがけましく、1.0  $\mu$  m以上であることが一層好ましい。これにより、圧延工程においてメッキ層 52 を圧延したとしても、メッキ層 52 にクラックが生じることを抑制できる観点で好ましい。

また、メッキ処理によって形成されるメッキ層 52 の厚さとしては、例えば、 $3.5\mu$  m 以下であることが好ましく、 $3.3\mu$  m以下であることがより好ましく、 $3.1\mu$  m以下であることが一層好ましい。これにより、メッキ処理のコストを低減しつつ、十分にメッキ濡れ性を確保できる観点で好ましい。

## [0047]

< 打ち抜き工程 >

打ち抜き工程は、メッキ板53に打ち抜き加工を施して、被メッキ面及び露出面を備える端子素片30Pを得る工程である(図15)。

打ち抜き加工の方法としては限定されない。打ち抜き加工の方法としては、具体的には、 プレス金型を用いてメッキ板をプレスする方法などが挙げられる。

#### [0048]

端子素片30Pの形状としては限定されない。端子素片30Pの形状としては、例えば、図4に係る端子30を製造する場合、図15に記載するように端子素片30Pを打ち抜くことが好ましい。図15に示すように、端子素片30Pは、曲げ加工をすることなく端子30を形成できるように、2つの曲がり部34、35と、基板接続部31となる基板接続素片部31Pとを備える。すなわち、端子の曲がり部を備えるように、端子素片を打ち抜くことが好ましい。このような方法によれば、打ち抜き後に基板接続部31や中間部32に必要な曲がり形状を形成するための曲げ加工を行う必要がなく、スプリングバックの影響を考慮する必要がない。これにより、端子30の寸法精度を向上できる観点で好ましい。【0049】

また、図 1 5 の断面を E - E 断面を図 1 6 に示す。図 1 6 に示すように、端子素片 3 0 P は、例えば、基材 4 1 となる素片基材 4 1 P と、メッキ層 4 4 P とを備える。

素片基材41Pは、メッキ層44Pによって覆われた2つの板面42Pと、打ち抜きによって形成され、2つの板面42Pを繋ぐ破断面43Pとを有している。破断面43Pは、メッキ層44Pによって覆われておらず、素片基材41Pが露出した露出面となっている。

## [0050]

〈圧延工程〉

圧延工程では、端子素片に圧延加工を施して、メッキ層を圧延し、第一傾斜面を形成する。圧延加工する方法としては限定されず、具体的には、金型を用いて端子素片を押圧する方法などが挙げられる。

これにより、端子素片の基材が押圧され、端子の斜面が形成される。また、端子素片のメッキ層が押圧され、端子の第1傾斜面が形成される。

## [0051]

圧延工程によって、基板接続素片部31 Pが押圧される。これにより、上述した対向斜面42 A1、42 B1 と対向傾斜部44 A1、44 B1、第1起立斜面42 A2、42 B2、第2起立斜面42 A3、42 B3、第1起立傾斜部44 A2、44 B2、および第2起立傾斜部44 A3、44 B3 が形成される。

## [0052]

(メッキ厚の平均値)

対向傾斜部 4 4 B 1 、第 1 起立傾斜部 4 4 B 2 及び第 2 起立傾斜部 4 4 B 3 のメッキ厚の平均値としては、例えば、 0 . 5  $\mu$  m以上であることが好ましく、 0 . 7  $\mu$  m以上であることが好ましく、 0 . 9  $\mu$  m以上であることがより好ましく、 1 . 0  $\mu$  m以上であること

10

20

30

40

が一層好ましい。  $3.5\mu$ m以下であることが好ましく、  $3.3\mu$ m以下であることがより好ましく、  $3.0\mu$ m以下であることが一層好ましい。これにより、メッキの均一性に優れることにより、長期信頼性に優れた端子を実現することができる。

#### [0053]

(メッキ厚の標準偏差)

対向傾斜部 4 4 B 1 、第 1 起立傾斜部 4 4 B 2 及び第 2 起立傾斜部 4 4 B 3 のメッキ厚の標準偏差としては、例えば、 0 . 4 0  $\mu$  m以下であることが好ましく、 0 . 3 5  $\mu$  m以下であることがより好ましく、 0 . 2 5  $\mu$  m以下であることが一層好ましい。これにより、メッキの均一性に優れることにより、長期信頼性に優れた端子を実現することができる。

#### [0054]

圧延工程に次いで、例えば、端子を曲げ加工してもよい。曲げ加工としては、具体的には、端子接続部33を形成する曲げ加工、曲げ部分を形成する曲げ加工などが挙げられる。本実施形態に係る端子の製造方法においては、例えば、曲げ部分を形成する曲げ加工を行わないように打ち抜き工程を行うことが好ましい。これにより、スプリングバックの影響を考慮する必要がない。これにより、端子30の寸法精度を向上できる観点で好ましい。

#### [0055]

(基板用コネクタ20の製造方法)

本実施形態に係る基板用コネクタ20の製造方法について説明する。

本実施形態に係る基板用コネクタ20は、例えば、端子接続部33を、対応する<u>端子圧入</u> <u>孔24</u>に圧入することによって、複数の端子30のそれぞれをコネクタハウジング21に 組み付けて製造される。

#### [0056]

(コネクタ付き基板の製造方法)

コネクタ付き基板は、基板用コネクタ 2 0 を回路基板 1 0 に対して、リフローはんだ付けなどにより実装することで製造される。

以下、詳細を説明する。

## [0057]

まず、回路基板10の一面において半田付けが予定されている各部位に予め半田Hを塗布する。続いて、基板用コネクタ20を、回路基板10の所定位置に載置する。このとき、各端子30は、回路基板10に対して垂直な姿勢で配され、基板接続部31が半田H上に載せられ、基板対向端面43Aが回路基板10に対向して配される。また、各固定金具27も同じく半田H上に載せられる。

#### [0058]

次に、基板用コネクタ20を載せた回路基板10を図示しないリフロー炉内に走行させ、半田Hを溶融させる。そののち半田Hが冷却固化されると、各端子30の基板接続部31が対応する導電路に固着されて導通がとられるとともに、各固定金具27が回路基板10に対して固着される。これにより、基板用コネクタ20が回路基板10に対して固定される。

## [0059]

リフローはんだ付けの際には、半田Hがリフロー炉の熱によって溶融し、図9に示すように、基板対向端面43Aおよび対向斜面42A1、42B1に濡れ広がり、基板対向端面43Aが半田Hに埋設された状態となる。ここで、図9に示すように、基板接続部31において、回路基板10に対向し、回路基板10に対する接続面となる基板対向端面43Aは、メッキが施されておらず、基材41が露出した露出面であるので、メッキが施された面と比較して半田Hの濡れ性が劣ることがある。しかし、上記したように、圧延によって基板対向端面43Aの面積が相対的に小さくなっているので、十分な濡れ性を発現できる。また、基板対向端面43Aに隣接する対向斜面42A1、42B1は、回路基板10の方を向くように傾いているため、この対向斜面42A1、42B1も回路基板10に対す

10

20

30

40

る接続面として働く。これらの対向斜面42A1、42B1は、メッキ層44A、44Bによって覆われており、半田Hの濡れ性が良くなっているため、半田Hがスムーズに濡れ上がり、良好な半田フィレットが形成される。これにより、回路基板10に対する端子30の接続信頼性が向上する。

#### [0060]

また、第1起立端面43Bおよび第1起立斜面42A2、42B2にも、半田Hが濡れ広がる。第1起立端面43Bも、基板対向端面43Aと同様に、メッキが施されておらず、基材41が露出した露出面であるので、メッキが施された面と比較して半田Hの濡れ性が劣ることがある。しかし、上記したように、圧延によって第1起立端面43Bの面積が相対的に小さくなっているので、十分な濡れ性が発現できる。また、第1起立端面43Bに隣接する第1起立斜面42A2、42B2はメッキ層44A、44Bによって覆われており、半田Hの濡れ性が良くなっているため、半田Hがスムーズに濡れ上がり、良好な半田フィレットが形成される(図12参照)。かりに端子30に荷重がかかる場合、第1起立端面43Bの周囲に応力集中が起こり、半田Hにクラックが生じることが懸念される。本実施形態に係る端子30は、第1起立端面43Bの周辺にも好適にはんだが濡れ上がるため、回路基板10及び端子30の接続を強力にできる観点で好ましい。

#### [0061]

第 2 起立端面 4 3 C および第 2 起立斜面 4 2 A 3 、 4 2 B 3 についても同様である。

#### [0062]

なお、本発明は上述の実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的を達成できる範囲での変形、改良等は本発明に含まれるものである。

#### 【実施例】

## [0063]

以下、実施例を用いて本発明を詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例の記載に何ら 限定されるものではない。

実施例として製造した端子について詳細を説明する。

#### [0064]

まず、端子の基材となる材料として、厚さ 0 . 1 mmの銅合金によって構成される板材を準備した。 次いで、金属板材の両面に電解メッキを施し、スズメッキからなるメッキ層を形成し、メッキ板を得た。なお、金属板材上に形成されたメッキ層の厚さは、1 . 8 μmであった。

次いで、メッキ板を打ち抜いて端子素片を形成した。なお、端子素片の形状としては、図4において、端子接続部33を曲げ加工する前の形状とした。プレス体を打ち抜く方向としては、板材を上面視して、図4の端子接続部33を曲げ加工する前の形状を打ち抜く方向とした。次いで、金型で端子素片をプレスすることにより、端子素片のメッキ層を圧延した。次いで、端子素片の端子接続部を曲げ加工し、実施例に係る端子を得た。

#### [0065]

## (メッキの厚み確認)

蛍光 X 線膜厚計(日立ハイテクサイエンス社製、STF9550 X)を用いて、図12の対向傾斜部44B1、第1起立傾斜部44B2及び第2起立傾斜部44B3のそれぞれの位置におけるメッキ厚を測定した。測定条件としては、測定範囲 0.03 mmとし、任意の5点について評価し、平均化した。測定結果を下記表1に示す。

### [0066]

また、対向傾斜部44B1、第1起立傾斜部44B2及び第2起立傾斜部44B3の位置におけるメッキ厚の平均値、標準偏差を算出した。あわせて下記表1に示す。

## [0067]

20

10

30

## 【表1】

	メッキ厚(μm)	
対向傾斜部	1.37	
第1起立傾斜部	1.24	
第2起立傾斜部	1.77	
平均值	1.46	
標準偏差	0.23	

#### [0068]

実施例に係る端子は、従来の端子と比べて、十分な半田濡れ性を維持することが確認され た。さらに、従来の先メッキ法で作成した端子と比べても、製造コストが低減できること が確認された。

## 【符号の説明】

#### [0069]

- 10…回路基板
- 20 ... 基板用コネクタ
- 21...コネクタハウジング
- 22...ハウジング本体
- 23...端子保持壁
- 2 4 ... 端子圧入孔
- 2 5 ... 固定壁部
- 2 6 ... 固定金具圧入孔
- 2 7 ... 固定金具
- 3 0 ... 端子
- 3 0 P ... 端子素片
- 3 1 ... 基板接続部
- 3 1 P ... 基板接続素片部
- 3 2 ... 中間部
- 33...端子接続部
- 34…第1曲がり部(曲げ部分)
- 35…第2曲がり部(曲げ部分)
- 4 1 ... 基材
- 4 1 P ... 素片基材
- 42A、42B...板面
- 4 2 A 1、4 2 B 1 ... 対向斜面(斜面)
- 4 2 A 2 、 4 2 B 2 ... 第 1 起立斜面(斜面)
- 4 2 A 3 、 4 2 B 3 … 第 2 起立斜面 (斜面)
- 4 2 A 4 、 4 2 B 4 … 非傾斜面 (被メッキ面)
- 4 2 P...板面
- 4 3 ... 端面
- 4 3 A ... 基板対向端面(露出面)
- 43B…第1起立端面(起立面)
- 43 C ... 第2起立端面(起立面)
- 4 3 P...破断面
- 4 4 A 、 4 4 B ... メッキ層
- 4 4 A 1 、 4 4 B 1 ... 対向傾斜部
- 4 4 A 2 、 4 4 B 2 ... 第 1 起立傾斜部
- 4 4 A 3 、 4 4 B 3 … 第 2 起立傾斜部
- 4 4 P ... メッキ層
- 45A1、45B1...対向傾斜面(第1傾斜面)

10

20

30

40

45A2、45B2...第1起立傾斜面(第2傾斜面)

45A3、45B3…第2起立傾斜面(第2傾斜面)

5 1 ... 板材

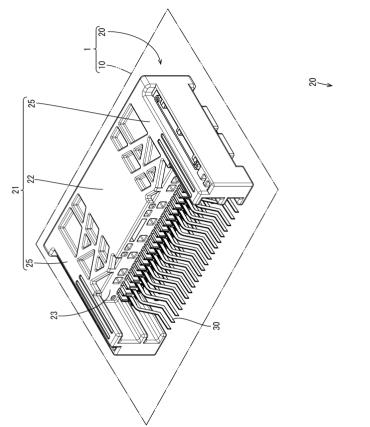
5 2 ... メッキ層

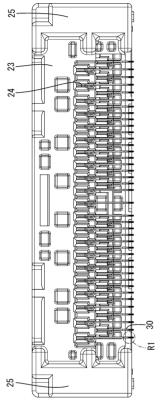
5 3 ... メッキ板

H ... 半田

【図面】

【図1】 【図2】

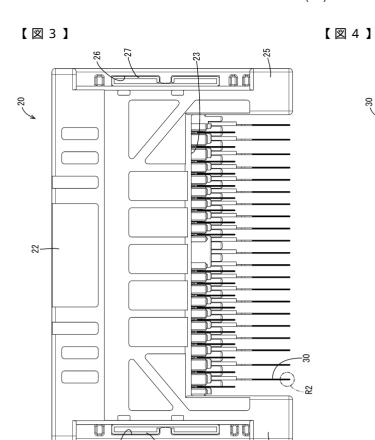


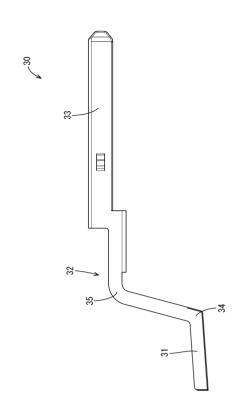


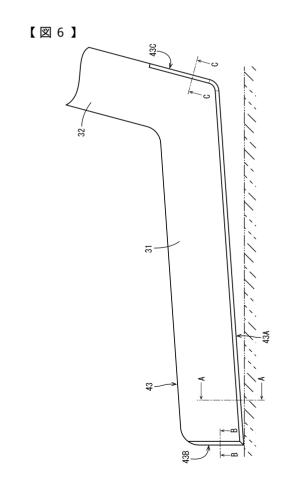
10

20

30



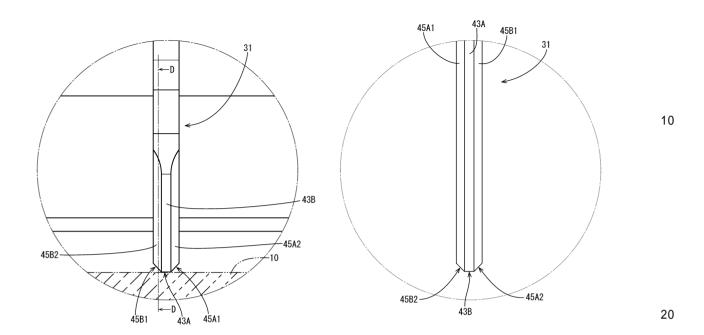




【図7】 【図8】

44A1 45A1

45B1 44B1



(14)

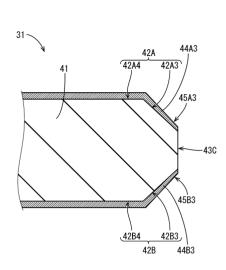
<u>42B2</u>

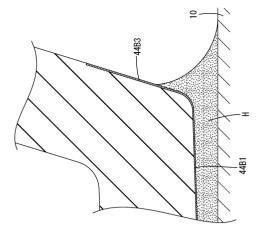
44B2

42B4 42B

【図11】





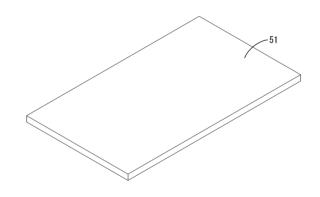


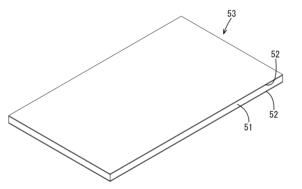


10

【図13】

【図14】

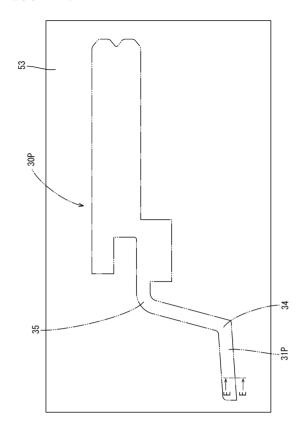


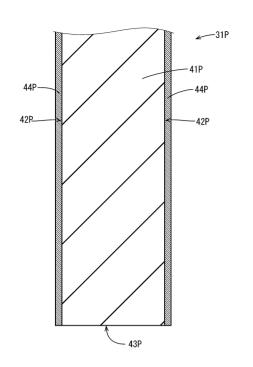


40

【図15】







## フロントページの続き

(56)参考文献 実開平7-14569(JP,U)

> 特表2002-505513(JP,A) 特開平9-246450 (JP,A)

特開2015-60815(JP,A)

(58)調査した分野 (Int.Cl., DB名)

H01R 12/57 H01R 13/03 H01R 43/16